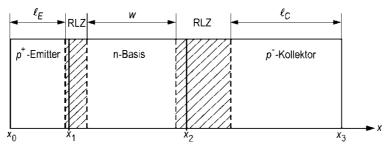
WS 2014/2015 Ausgabe am: 06.02.2015

## Übungsblatt 14

## **Aufgabe 1:** Bipolartransistor

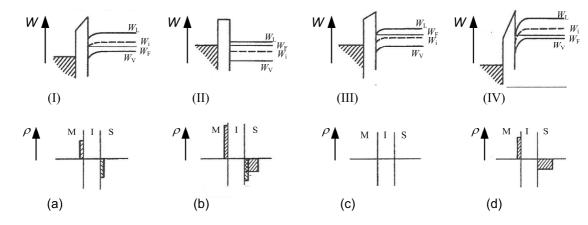


Betrachtet wird ein pnp-Transistor aus Silizium. Die Dotierungen von Emitter, Basis und Kollektor betragen  $n_{AE} = 1 \cdot 10^{19}$  cm<sup>-3</sup>,  $n_{DB} = 2 \cdot 10^{17}$  cm<sup>-3</sup>,  $n_{AC} = 5 \cdot 10^{15}$  cm<sup>-3</sup>. Die zugehörigen physikalischen Längen betragen  $(x_1 - x_0) = 1$  µm,  $(x_2 - x_1) = 0.2$  µm,  $(x_3 - x_2) = 3$  µm. Gehen Sie im Folgenden davon aus, dass die Schottky-Näherung gilt, Störstellenerschöpfung vorliegt und die Temperatur T = 300 K beträgt. Die intrinsische Ladungsträgerdichte beträgt  $n_i = 1.5 \cdot 10^{10}$  cm<sup>-3</sup>.

- 1.1 Skizzieren Sie den Verlauf von Valenzband, Leitungsband und Fermi-Niveau für eine Basis-Emitter-Spannung  $U_{\rm BE}=0$  V und eine Basis-Kollektor-Spannung  $U_{\rm BC}=0$  V. Markieren Sie die Raumladungszonen.
- 1.2 Nun wird eine Basis-Emitter-Spannung  $U_{\rm BE}$  = -0,7 V und eine Basis-Kollektor Spannung  $U_{\rm BC}$  = 0,8 V angelegt.
  - (a) Werden die Übergänge dabei jeweils in Sperr- oder Durchlassrichtung gepolt? Welcher Betriebszustand des Transistors ergibt sich?
  - (b) Werden die Raumladungszonen kleiner oder größer im Vergleich zu  $U_{\rm BE} = U_{\rm BC} = 0$ ?
  - (c) Skizzieren und beschriften Sie die Bandverläufe, sowie die Quasi-Fermi-Niveaus.
  - (d) Skizzieren und beschriften Sie den Verlauf der Trägerdichten außerhalb der Raumladungszonen.

## **Aufgabe 2:** MOSFET und MIS-Struktur

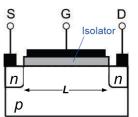
2.1 Im Folgenden sind vier verschiedene Metall-Isolator-Halbleiter-(MIS-)Strukturen skizziert. Ordnen Sie den Bandverläufen (I) bis (IV) die Ladungsträgerverteilungen (a) bis (d) zu. Bestimmen Sie dabei, welche Dotierung (n oder p) im Halbleiter vorliegt.  $W_F$  bezeichnet die Fermi-Energie,  $W_i$  die Mitte der Bandlücke.



2.2 Ordnen Sie die gezeigten Bandverläufe den folgenden Betriebszuständen der MIS-Struktur zu: Verarmung, Anreicherung, starke Inversion, Flachbandfall.

1

Bei einem *n*-Kanal MOSFET beträgt die Kanallänge  $L = 2 \,\mu\text{m}$ , die Kanalbreite  $b = 15 \,\mu\text{m}$  (senkrecht zur Zeichenebene), und der Kapazitätsbelag des Gates wird mit  $C' = 6.9 \cdot 10^{-8} \,\text{F/cm}^2$  angegeben.



Für eine Drain-Source-Spannung von  $U_{\rm DS}$  = 0,1 V werden im ohmschen Bereich die folgenden Drainströme  $I_{\rm D}$  gemessen:

Arbeitspunkt 1:  $U_{GS} = 1.5 \text{ V}$ ,  $I_D = 35 \mu\text{A}$ ;

Arbeitspunkt 2:  $U_{GS} = 2.5 \text{ V}$ ,  $I_D = 75 \mu\text{A}$ .

- 2.3 Berechnen Sie für den oben beschriebenen MOSFET die Schwellenspannung  $U_{\rm th}$  und die Elektronenbeweglichkeit  $\mu_{\rm n}$  im Kanal.
- 2.4 An das oben beschriebene Bauteil wird eine Gate-Source-Spannung von  $U_{GS} = 2,5$  V angelegt. Berechnen Sie die Drain-Source-Spannung, bei welcher der Sättigungsbereich beginnt, sowie den Sättigungsstrom.

## **Aufgabe 3:** Beleuchtete Halbleiterprobe

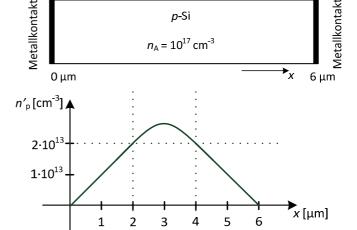
Eine  $6 \,\mu m$  lange Siliziumprobe ist an beiden Enden metallisiert. Eine externe Spannung ist nicht angelegt. Die Probe wird räumlich inhomogen in einer Weise beleuchtet, dass die stationäre Überschussminoritätsträgerdichte  $n'_p(x)$  den folgenden Verlauf zeigt:

$$n'_{p}(x) = \begin{cases} 10^{25} \text{ m}^{-4}x & \text{für } 0 \text{ } \mu\text{m} \le x \le 2 \text{ } \mu\text{m} \\ 2,5 \cdot 10^{19} \text{ m}^{-3} - 0,5 \cdot 10^{31} \text{ m}^{-5} (x - 3 \text{ } \mu\text{m})^{2} & \text{für } 2 \text{ } \mu\text{m} < x \le 4 \text{ } \mu\text{m} \\ 10^{25} \text{ m}^{-4} (6 \text{ } \mu\text{m} - x) & \text{für } 4 \text{ } \mu\text{m} < x \le 6 \text{ } \mu\text{m} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Die Probe ist *p*-dotiert mit einer Dichte von  $n_A = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ . Die Beweglichkeit der

Elektronen ist  $\mu_n = 1600 \frac{\text{cm}^2}{\text{Vs}}$ , die der Löcher

 $\mu_{\rm p} = 800 \, \frac{{\rm cm}^2}{{\rm Vs}}$ . Die Eigenleitungsträgerdichte ist  $n_{\rm i} = 10^{10} \, {\rm cm}^{-3}$  und die Diffusionslänge der Minoritätsträger beträgt  $L_{\rm h} = 60 \, {\rm \mu m}$ . Nehmen Sie für alle Berechnungen schwache Injektion an und gehen Sie davon aus, dass sich die Probe im stationären Zustand befindet. Die Temperatur beträgt  $T = 300 \, {\rm K}$  und es liegt Störstellenerschöpfung vor.



- 3.1 Berechnen Sie die Diffusionskonstanten  $D_n$  und  $D_p$  sowie die Minoritätsträgerlebensdauer  $\tau_n$  des Halbleiters.
- 3.2 Berechnen Sie den Verlauf der Minoritätsträgerstromdichte  $J_n(x)$  im Intervall $0 < x < 6 \,\mu\text{m}$  und skizzieren Sie den Verlauf. Verwenden Sie dabei sinnvolle Näherungen und begründen Sie Ihr Vorgehen.
- 3.3 Welche Überschussmajoritätsträgerdichte  $p'_p(x)$  und Majoritätsträgerstromdichte  $J_p(x)$  stellen sich im stationären Zustand ein? Verwenden Sie sinnvolle Näherungen und begründen Sie Ihr Vorgehen. (2,5 Punkte)
- 3.4 Berechnen Sie den Verlauf der Generationsfunktion  $g_L(x)$  im Intervall  $0 < x < 6 \,\mu\text{m}$  unter Vernachlässigung der Rekombination im Volumen des Halbleiters. Gehen Sie davon aus, dass sich die Probe nach wie vor im stationären Zustand befindet.